高分解能 RBS 装置

製造元	株式会社 神戸製鋼所
仕様	高分解能 RBS(ラザフォード後方散乱分光)装置、イオン種: He+イオン、最大加速電圧: 400 kV、最大試料サイズ(mm)20×20×3、、深さ分解能 1 nm 以下
保有部署	マイクロエンジニアリング専攻ナノ物性工学研究室
設置場所	桂・C3 棟・地下 1 階 bB1N01 室)
利用期間·時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/itrgsw.pdf
注意事項等	依頼測定のほか利用者自身による測定も可能。ただし事前講習の受講が必要。
連絡先	マイクロエンジニアリング専攻ナノ物性工学研究室 中嶋薫 075-383-3707 nakajima.kaoru.4a@kyoto-u.ac.jp
キーワード	イオン散乱分析、極薄膜、元素組成、非破壊深さ方向分析、超高真空
機器コード	_
自由記入欄	極薄膜の元素組成の分析に最適。非破壊で高分解能の深さ方向分析(最表面~数 10 nm の深さ領域)ができる。絶縁物の分析も可能。



